

第22回RCJシンポジウムで最優秀論文を受賞

平成22年から経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業で「MEMS 技術を応用した静電気非接触可視化システムの実用化」(参画機関: 阪和電子工業(株)、近畿大学、和歌山県工業技術センター)を実施し、誘導帯電を実時間で可視化することに成功しました。

その開発に関する研究論文(「小帯電板による絶縁板への誘導帯電を可視化する試み」中家 利幸、松井 順、宮本 佳明(阪和電子工業(株))、栗山 敏秀(近畿大学)前田 裕司、高辻 渉、上野 吉史、伊東 隆喜(和歌山県工業技術センター)、RCJ信頼性シンポジウム、Vol22、PP 139~142、2012)が、このたび、第22回RCJシンポジウム最優秀論文に選ばれました。

またそれに続き、今秋開催されるEOS/ESDシンポジウム国際学会(場所: アメリカ合衆国ラスベガス、会場名: Rio All Suites Hotel、日時: 2013年9月10日)で阪和電子工業株式会社取締役技監中家利幸氏が「Real-Time Visualization Measurement of Electrostatic Potential on the Surface of a Dielectric Plate with a Small Charged Metal Plate」について招待講演をしました。

掲載日付: 2013 年 10 月 01 日